(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001 年10 月25 日 (25.10.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/79211 A1

(51) 国際特許分類?:

C07D 501/04, 501/22

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/03182

(22) 国際出願日:

2001年4月13日 (13.04.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の曾語:

日本語

(30) 優先権データ:

特顧2000-111448 2000年4月13日(13.04.2000) 刃

(71) 出願人: 大塚化学株式会社 (OTSUKA KAGAKU KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒540-0021 大阪府大阪市中央区大手通3丁目2書27号 Osaka (JP).

(72) 免明者: 亀山 豊 (KAMEYAMA, Yutaka). 深江一 各PCTガゼットの巻頭に掲載さ 博 (FUKAE, Kazubiro); 〒771-0193 徳島県徳島市川 のガイダンスノート」を参照。

内町加賀須野463 大塚化学株式会社 德島研究所内 Tokushima (JP).

(74) 代理人: 田村 巖(TAMURA, Iwao); 〒561-0872 大阪府豊中市寺内1丁目9署22号 田村特許事務所 Osaka (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, KR.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CIL, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開書類: — 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期免行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PROCESS FOR THE PREPARATION OF A 3-VINYLCEPHEM COMPOUND

(54) 発明の名称: 3ーピニルーセフェム化合物の製造方法

$$R^1NH \longrightarrow N \longrightarrow CO-HN \longrightarrow S \longrightarrow CO_2R^3$$
 (1)

$$H_2N \stackrel{N}{\searrow} OH OH CO_2H (2)$$

(57) Abstract: A process for the preparation of a 3-vinylcephem compound, characterized by treating a protected 3-vinylcephem derivative of the general formula (1) in an organic solvent in the presence of a perhalogenic acid and an organic protonic acid to thereby obtain a 3-vinylcephem compound of formula (2). In general formula (1), R¹, R² and R³ are each hydrogen or optionally substituted arylmethyl, with the proviso that all of R¹, R² and R³ must not be hydrogen.

WO 01/79211 A1

(57) 要約:

式(1)で表される保護された3-ビニルーセフェム誘導体を有機溶媒中過ハロゲン化酸および有機プロトン酸の存在下に処理して式(2)で表される3-ビニルーセフェム化合物を得ることを特徴とする3-ビニルーセフェム化合物の製造方法。

$$R^{1}NH \longrightarrow N \longrightarrow CO-HN \longrightarrow S$$
 $OR^{2} \longrightarrow OR^{2}$
 $CO_{2}R^{3}$ (1)

(式中 R^1 、 R^2 及び R^3 は水素原子または置換基を有することのあるアリールメチル基を示す。但し、 R^1 、 R^2 及び R^3 は同時に水素原子ではない。)

$$H_2N$$
 S
 OH
 OH
 CO_2H
 (2)

明細書

3-ビニルーセフェム化合物の製造方法

5 技術分野

本発明は、経口用抗生物質として幅広く使用されているセフジニル化合物の製造方法に関する。

背景技術

セフジニル化合物は、通常アミノ基、オキシム水酸基、カルボキシル基の少な 10 くとも一つを保護した形で誘導される場合が多い。これらは最終段階で脱保護反 応を行い(6R, 7R) -3-ピニル-8-オキソ $-7\beta-$ [(Z) -2-(2 ーアミノー4ーチアゾリル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-1-アザ -5-チアピシクロ[4.2.0] オクタン-2-カルボン酸(セフジニル)へと 導かれる。しかしながら、これらの化合物の脱保護反応は分子内に種々の官能基 15 を持つセフジニル化合物では未だ決め手になる脱保護方法が確立していない。例 えば特公平1-49273号においては、式(1)で表される化合物でR¹=R ²=H, R³=CHPh₂の化合物が、アニソール/酢酸中、三フッ化ホウ素エ ーテレートを用いて脱保護反応を受けているが、反応収率が35%と低いばかり 20 か、危険な三フッ化ホウ素化合物を多量に用いなければならず、とても工業的な 方法とは言えない。また、特開昭62-294687号ではセフェム系抗生物質 の脱保護反応として広く用いられている脱保護方法、即ちアニソール存在下トリ フルオロ酢酸による脱保護を行う方法が紹介されているが、その揮発性、取り扱 いの煩雑さ及び高価であるという理由から、工業的に使用しにくいトリフルオロ 酢酸を多量に使用しなければならず、またこのような方法でさえ反応収率が2 25

8%という低収率であり、とても工業的に実施できる方法ではない。

セフジニルの合成方法としては紹介されていないがカルボン酸保護基の脱保護 方法として、99%蟻酸を溶媒として用いる方法 [Chem. Pharm. Bull., 3 0, 4545 (1982)]、アニソール存在下に塩化アルミニウムと反応させる 方法 [Tetrahedron Lett., 2793 (1979)]、フェノール類を用いる方・-法 [J. Org, Chem., 56, 3633 (1991)] も知られている。蟻酸を 使用する方法では高価な99%蟻酸を反応溶媒として大過剰に使用する必要があ り、その回収、再使用工程で酸に不安定なβーラクタム誘導体が分解するため生 成したカルボン酸化合物の収率が低下する。また、アニソール存在下塩化アルミ ニウムを使用する方法では塩化アルミニウムの酸性度の強さからセフジニルの合 10 成には適用できない。また、フェノール類を使用する方法では蟻酸やトリフルオ 口酢酸を多量に使用した場合と同様、強酸性条件下で不安定なセフジニルでは収 率良く反応を進行させることが出来ない。また、これらすべての反応において最 終セフジニルではオキシム基が水酸基となるため多量のプロトン酸や強力なルイ ス酸のもとではシン/アンチの異性化が進行し不適切な不純物を増加させるため 15 これらの脱保護方法は使用できない。

このように β ーラクタム化合物における一般的な酸加水分解による脱保護反応では目的のセフジニル化合物を収率及び選択性良く製造することは極めて困難な状況にあったため、工業的に安価且つ効率の良い脱保護方法の出現が望まれていた。

本発明の目的は、式(1)で表される保護された3-ビニルーセフェム誘導体から式(2)で表される3-ビニルーセフェム化合物を高価な試薬を使用することなく、効率良く製造し得る新規な技術を提供することにある。

25 発明の開示

20

10

15

本発明は式(1)で表される保護された3-ビニルーセフェム誘導体を有機溶媒中過ハロゲン化酸および有機プロトン酸の存在下に処理して式(2)で表される3-ビニルーセフェム化合物を得ることを特徴とする3-ビニルーセフェム化合物の製造方法に係る。

$$R^1NH \longrightarrow N \longrightarrow CO-HN \longrightarrow S \longrightarrow CO_2R^3$$
 (1)

5 (式中 R^1 , R^2 及び R^3 は水素原子または置換基を有することのあるアリールメチル基を示す。但し、 R^1 , R^2 及び R^3 は同時に水素原子ではない。)

$$H_2N \longrightarrow S$$
 OH OH OO_2H (2)

本発明では、酸に不安定なセフジニル化合物の脱保護反応を効率良く行うため有機溶媒中において、原料骨格中のアミド基およびアミノ基に対し弱い有機プロトン酸を水素結合させ、強力な過ハロゲン化酸を必要量のみ使用することにより、セフジニル化合物を安定にまた収率良く合成することが可能となった。本反応では反応に寄与できる強力な過ハロゲン化酸は必要最小限の量のみしか使用しないため反応系で安定にセフジニル化合物が存在し得る。また、多量の酸を必要としないため、後処理も使用した酸の量にあわせて必要量の塩基で有機溶媒中から抽出するのみで簡単に単離操作が行えるのも特徴で、工業的に簡便且つ安価に製造可能な製造方法を確立することに成功した。

10

15

本発明において、R¹、R²、R³で表される置換基を有することのあるアリールメチル基としては、置換基を有してもよいベンジル基、ジフェニルメチル基、トリチル基、アニシルメチル基、ナフチルメチル基等をあらわす。置換していても良い置換基としては、ヒドロキシ基、メチル、エチル、tertープチル等の炭素数1~4の低級アルキル基、メトキシ、エトキシ等の炭素数1~4の低級アルコキシ基等を挙げることが出来る。ジフェニルメチル基には、置換又は非置換のフェニル基がメチレン鎖あるいはヘテロ原子を介して分子内で結合しているタイプのものも含有される。具体例としては、ベンジル基、pーメトキシベンジル基、ジフェニルメチル基、トリチル基、3,4,5ートリメトキシベンジル基、3,5ージメトキシー4ーヒドロキシベンジル基、2,4,6ートリメチルベンジル基、ジトリルメチル基等を挙げることができる。

本発明で使用できる有機プロトン酸としては、pKa=3~5のものが好まして、例えば増酸、酢酸、クロロ酢酸、プロピオン酸、2-エデルヘキサン酸等の置換もしくは無置換の低級アルキルカルボン酸、安息香酸、トルイル酸等の置換もしくは無置換の芳香族カルボン酸等が幅広く利用できる。

有機プロトン酸の使用量としては、上記式(1)の化合物に対し、通常 $1\sim2$ 0倍モル当量、好ましくは $2.5\sim10$ 倍モル当量、特に好ましくは $3\sim5$ 倍モル当量である。

過ハロゲン化酸としては、過塩素酸、過ヨウ素酸、過臭素酸等が例示できる。 20 その使用量としては通常触媒量用いれば良いが、式(1)の化合物に対して通常 0.1~5倍モル当量使用するのが好ましい。

過ハロゲン化酸の濃度としては通常市販されている60%の物がそのまま使用できるが、反応系により10~50%の範囲で希釈して用いることも出来る。

本発明で使用できる有機溶媒としては、蟷酸メチル、蟻酸エチル、蟻酸プロピ 25 ル、蟻酸プチル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸プチル、プロピ オン酸メチル、プロピオン酸エチル等の低級カルポン酸の低級アルキルエステル類、アセトン、メチルエチルケトン、メチルプロピルケトン、メチルプチルケトン、メチルイソプチルケトン、ジエチルケトン等のケトン類、アセトニトリル、プロピオニトリル、プチロニトリル、イソプチロニトリル、パレロニトリル等のニトリル類、ペンゼン、トルエン、キシレン、クロロペンゼン、アニソール等の置換もしくは未置換の芳香族炭化水素類、ジクロロメタン、クロロホルム、ジクロロエタン、トリクロロエタン、ジプロモエタン、プロピレンジクロライド、四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素類、ペンタン、ヘキサン、ヘブタン、オクタン等の脂肪族炭化水素類、シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロヘブタン、シクロオクタン等のシクロアルカン類を挙げることができる。特に好ましい溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレン、ジクロロメタン、クロロホルム、ジクロエタンが挙げられる。これらは1種単独で又は2種以上混合して使用される。

またこれらの有機溶媒には、必要に応じて水が含有されていてもよい。これらの溶媒は、式(1)の化合物1kg当たり、通常2~200L程度、好ましくは3~100L程度使用されるのがよい。反応は-20~100℃、好ましくは0~50℃の範囲で行なわれる。

式(2)の化合物は、反応終了後、通常の抽出操作或いは晶析操作を行なうことによりほぼ純品として得ることができるが、その他の方法によっても勿論精製することができる。

20

10

15

発明を実施するための最良の形態

以下に実施例を挙げて、本発明を具体的に説明するが、これに限定されるものではない。

実施例1

25 式 (1) において R^1 が水素原子、 R^2 がトリチル基、 R^3 が水素原子である化

合物 (1 a) 1 gを塩化メチレン10m1に溶解し、この溶液に98% (w/w) 蟻酸0.18m1 (3当量) および60% (w/w) 過塩素酸0.16ml (1.6当量) を加え、30℃で1時間反応させた。この反応液に飽和重曹水7mlを加えて目的物を抽出した。得られた水層に2規定塩酸を加えてpH=3.0に調整し、0~3℃に冷却した。1時間後、析出した結晶を吸引ろ過、減圧乾燥を行って目的の式(2)のセフジニル化合物を0.59g (収率95%) 得た。1H NMR (DMSO-d₆) 3.32 (s,1H),3.53 (d,J=18Hz,1H),3.81 (d,J=18Hz,1H),5.16 (d,J=4.8Hz,1H),5.29 (d,J=11.7Hz,1H),5.56 (d,J=17.1Hz,1H),5.76 (dd,J=4.8,8.1Hz,1H),6.64 (s,1H),6.89 (dd,J=11.7,17.1Hz,1H),7.11 (s,2H),9.47 (d,J=8.1Hz,1H),11.3 (s,1H).

実施例2

原料化合物に式(1 a)の化合物のp - トルエンスルホン酸塩の2ジメチルア 15 セトアミド配位結晶を用いて、実施例1と同様に反応を行った結果、収率96% で式(2)のセフジニル化合物を得た。得られたセフジニル化合物の1H NM Rは実施例1のそれと一致した。

実施例3~8

反応溶媒を変え、それにあわせて反応時間を調整した以外は実施例1と同様の 20 反応を行った結果を表1に示す。

【表1】

実施例	有機溶媒	反応時間(h r)	収率(%)
3	クロロホルム	1	9 5
4	ペンゼン	1	9 4
5	トルエン	1	9 4
6	キシレン	1	9 2
7	酢酸エチル	4	9 0
8	酢酸ブチル	4	8 9

実施例9~12

過塩素酸の濃度を変え、反応時間を調整した以外は実施例1と同様の反応を行 5 った結果を表2に示す。

【表2】

実施例	過塩素酸濃度 (%)	反応時間 (hr)	収率 (%)
9	45 .	1	9 6.
10	3 0	1	9 5
11	. 20	1.5	9 2
1 2	10	6	8 7

実施例13~16

プロトン酸を以下の酸に変えた以外は実施例1と同様の反応を行った結果を表 10 3に示す。

【表3】

実施例	プロトン酸	収率 (%)
1 3	酢酸	9 5
14	プロピオン酸	9 3
15	2 - エチルヘキサン酸	8 6
16	安息香酸	8 9

実施例17

化合物(1a)を化合物(1b, R¹=トリチル基, R²=トリチル基, R³ =水素原子)に変えた以外は実施例1と同様の反応を行った結果、収率91%で式(2)のセフジニル化合物が得られた。得られたセフジニル化合物の1H N MRは実施例1のそれと一致した。

実施例 1-8

化合物(1 a)を化合物(1 c, R¹=水素原子, R²=トリチル基, R³= 10 p-メトキシベンジル基)に変えた以外は実施例1と同様の反応を行った結果、収率92%で式(2)のセフジニル化合物が得られた。得られたセフジニル化合物の1H NMRは実施例1のそれと一致した。

実施例19

化合物 (1 a) を化合物 (1 d, R¹=水素原子, R²=トリチル基, R³=ジ フェニルメチル基) に変えた以外は実施例1と同様の反応を行った結果、収率9 4%で式(2) のセフジニル化合物が得られた。得られたセフジニル化合物の1 H NMRは実施例1のそれと一致した。

実施例20

化合物(1a)を化合物(1e, R^1 =トリチル基, R^2 =トリチル基, R^3 = p-メトキシベンジル基)に変えた以外は実施例1と同様の反応を行った結果、

収率89%で式(2)のセフジニル化合物が得られた。得られたセフジニル化合物の1H NMRは実施例1のそれと一致した。

実施例21

化合物(1 a)を化合物(1 f, R¹=トリチル基, R²=トリチル基, R³=ジフェニルメチル基)に変えた以外は実施例1と同様の反応を行った結果、収率91%で式(2)のセフジニル化合物が得られた。得られたセフジニル化合物の1H NMRは実施例1のそれと一致した。

産業上の利用可能性

10 本発明によれば、酸に不安定なセフジニル化合物を水素結合に必要な量の有機プロトン酸と、少量の過ハロゲン化酸の組み合わせにより、弱酸による水素結合と強酸による脱保護を有機溶媒中で巧妙に組み合わせ、酸に不安定なセフジニル化合物を高収率、高純度で製造することが可能となった。また必要最小限の酸を用いるため後処理も簡便で工業的に極めて容易なセフジニル化合物の製造方法を提供することが可能である。

請求の範囲

1. 式(1)で表される保護された3-ビニルーセフェム誘導体を有機 溶媒中過ハロゲン化酸および有機プロトン酸の存在下に処理して式(2)で表される3-ビニルーセフェム化合物を得ることを特徴とする3-ビニルーセフェム 化合物の製造方法。

$$R^1NH \longrightarrow N \longrightarrow CO-HN \longrightarrow S \longrightarrow CO_2R^3$$
 (1)

(式中 R^1 , R^2 及び R^3 は水素原子または置換基を有することのあるアリールメチル基を示す。但し、 R^1 , R^2 及び R^3 は同時に水素原子ではない。)

$$H_2N$$
 N
 OH
 OH
 CO_2H
 CO_2H
 CO_2H
 CO_2H

- 2. 式(1)で表される保護された3-ビニルーセフェム誘導体の水素 10 結合に必要な量の有機プロトン酸と、少量の過ハロゲン化酸を使用する請求の範 囲第1項に配載の製造方法。
 - 3. 有機プロトン酸の使用量が式(1)の化合物に対し1~20倍モル当量、過ハロゲン化酸の使用量が式(1)の化合物に対し0.1~5倍モル当量である請求の範囲第2項に記載の製造方法。
- 有機プロトン酸がpKa=3~5のものである請求の範囲第1項に 記載の製造方法。
 - 5. 有機プロトン酸が蟻酸、酢酸、クロロ酢酸、プロピオン酸、2-エ

チルヘキサン酸、安息香酸、トルイル酸である請求の範囲第4項に記載の製造方法。

- 6. 過ハロゲン化酸が過塩素酸、過ヨウ素酸、過臭素酸である請求の範囲第1項に記載の製造方法。
- 5 7. 置換基を有することのあるアリールメチル基が置換基を有してもよいペンジル基、ジフェニルメチル基、トリチル基、アニシルメチル基、ナフチルメチル基である請求の範囲第1項に記載の製造方法。
 - 8. 置換基が、ヒドロキシ基、炭素数1~4の低級アルキル基、炭素数1~4の低級アルコキシ基である請求の範囲第7項に記載の製造方法。
- 9. 置換基を有することのあるアリールメチル基がベンジル基、pーメトキシベンジル基、ジフェニルメチル基、トリチル基、3,4,5ートリメトキシベンジル基、3,5ージメトキシー4ーヒドロキシベンジル基、2,4,6ートリメチルベンジル基、ジトリルメチル基、アニシルメチル基、ナフチルヌチル基である請求の範囲第7項に記載の製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/03182

A CT AC	SINCATION OF CLUB IS CALLED	 -			
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl7 C07D501/04, C07D501/22					
According t	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIELD	S SRARCHED				
Minimum d	ocumentation searched (classification system followed	by classification symbols)			
Int.	.Cl7 C07D501/00-62				
Documentat	ion searched other than minimum documentation to th	e extent that such documents are included	in the fields searched		
Electronic d	ata bese consulted during the international search (name	ne of data base and, where practicable, sea	rch terms used)		
CAPI	JUS (STN) , REGISTRY (STN)				
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where a	paragine of the selection	D -1		
A			Relevant to claim No.		
_ ^	<pre>BP 105459 A2 (Pujisawa Pharmac 18 April, 1984 (18.04.84),</pre>	eutical Co., Ltd.),	1-9		
	& BE 897864 A1	18 A			
	& DK 8304270 A & AU 83192 & FI 8303370 A & GB 21278	77 Al			
	& FI 8303370 A & GB 21278	12 A1			
	& AT 8303427 A & CH 65785	7 A			
	& NO 8303531 A & FR 25339 & ES 526091 A1 & CA 12069	26 A1			
	E-JP 59-89689 A & JP 59-89	56 AL /			
	& JP 62-294687 A & US 45593	34 A			
	& ES 543013 A1 & AT 85035	54 A			
A	WO 96/26943 A1 (F.HOFFMANN-LA	ROCHE AG),	1-9		
	06 September, 1996 (06.09.96), especially, see pages 10-12	•			
	& EP 812323 A1 & US 59256	32 A			
	& JP 11-501017 A & AU 48771	96 A			
	& CA 2212345 A & FI 97350	0 A !	İ		
	& BR 9607046 A & CN 11766	41 A			
			ĺ		
Further	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	[
	categories of cited documents:	"I" later document published after the later			
conside	Cocument defining the general state of the art which is not priority date and not in conflict with the application but cited to considered to be of perticular relevance understand the principle or theory understand the principle or theory understand.				
"B" owtlier	earlier document but published on or after the internetional filing "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be				
"L" docume	CORRECTION OF COUNTY OF CO				
cited to	cited to establish the publication dute of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be				
	special reason (as specialize) considered to involve an inventive step when the document is				
Incans	means combination being obvious to a person skilled in the art				
"P" document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family than the priority date claimed					
	ctual completion of the international search	Date of mailing of the international search	h report		
	uly, 2001 (12.07.01)	24 July, 2001 (24.07			
None and matter address of the TOA!					
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer					
Facsimile No	.	Telephone No.	1		

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

	国際調査報告	·	国際出願	B号 PC	T/JP01	/03182
	属する分野の分類(国際特別 7D501/04, CO7D501/22	F分類(IPC))				
B. 調査を	た - ▲八郎					
関査を行った	170元 万町 最小限費料(国際特許分類) 70501/00-62	(I PC))				
最小限資料以	外の資料で調査を行った分別	た含まれるもの				
国際調査で使 CAPLUS (STI	用した電子データベース(デ V), REGISTRY(STN)	ーダベースの名称、	調査に使用した用	用額)		
	ると認められる文献					
引用文献の カテゴリー*	・ 引用文献名 及び一部	『の箇所が関連すると	さは、その関連す	トる箇所の	表示 :	関連する 請求の範囲の番号
A	EP 105459 A2 (東沢) 18.4月.1984 (18.04. &BE 897864 A1	基品工業株式会社	t)	K 83042		1-9
	&AU_8319277_A1	&FI 8303370		B 21278	1	
	&AT 8303427 A	&CH 657857	A &2N	O 83035		
	&FR 2533926 A1	&ES 526091		A 12069		
	&JP 59-89689 A &US 4559334 A	&JP 59-8969 &ES 543013	•	P 62–29 T 85035		
図 C欄の統	きにも文献が列挙されている	·	□ パテント	ファミリー	に関する別	 既を参照。
もの 「E」国際地に 以後先権 「L」優先権 ・ 文献 「O」ロ頭に	のカテゴリー 連のある文献ではなく、一般 順日前の出願または特許であ 公表されたもの 主張に延義を提起する文献又 くは他の特別な理由を確立す 理由を付す) よる開示、使用、展示等に質 願日前で、かつ優先権の主張	るが、国際出願日 は他の文献の発行 るために引用する 及する文献	出願と矛盾の理解のない。 「X」特に関連の の新規性又 「Y」特に関連の 上の文献と	又はる はない はない はない はない はない はない なが ない なが ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない	日ですでかった。とう、とう、とう、とう、このできない。とう、このできていった。とう、このにおいった。とう、このにおいった。とう、このには、このには、このには、このには、このには、このには、このには、このには	酸文献と他の1以 明である組合せに
国際調査を完	了した月 12.07	7. 01	国際調査報告の発	送日	24.0	7.01
日本	の名称及びあて先 国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915		特許庁審査官(拼	順限のある 高岡 裕		4P 9737
	都千代田区霞が関三丁目 4 福	3号 .	電話番号 03-	-3581	-1101	内線 3492

	٠.

国際出願番号 PCT/JP01/03182

カテゴリー* 3用支配名 及び一部の箇所が勘定するときは、その関連する箇所の表示	C(続き). 引用文献の カテゴリー*				関連する
		WO 96/26943 A1 (F 6.9月.1996 (06.09 &EP 812323 A1 &AU 4877196 A	. HOFFMANN-LA ROCHE AG) . 96) 特に第10~12 . &US 5925632 A . &CA 2212345 A	頁を参照 &TP 11-501017 A	請求の範囲の番号 1-9
	:			•	
	•				
	•			· .	
	. <i>•</i>				
		<i>.</i>			·
		•			
·			,		·

様式PCT/ISA/210 (第2ページの統含) (1998年7月)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

W BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE	POOR QUALITY
OTHER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.